PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

Patent number:

JP2002296780

Publication date:

2002-10-09

Inventor:

ODEMURA JUNJI; KAWAHARA KOHEI

Applicant:

NIPPON ZEON CO

Classification:

- International:

C08K5/00; C08L45/00; C08L65/00; C08L101/02; G03F7/039; G03F7/40; H01L21/027; C08K5/00; C08L45/00; C08L65/00; C08L101/00; G03F7/039; G03F7/40; H01L21/02; (IPC1-7): G03F7/039; C08K5/00;

C08L45/00; C08L65/00; C08L101/02; G03F7/40;

H01L21/027

- european:

Application number: JP20010100586 20010330 Priority number(s): JP20010100586 20010330

Report a data error here

Abstract of **JP2002296780**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive resin composition excellent in various performances of flatness, heat resistance, transparency, chemical resistance or the like, having good degassing property and excellent low dielectric property which can easily form a hardened film in a fine pattern. SOLUTION: The photosensitive resin composition contains cyclic olefin polymers, a dissolution controlling agent, a photoacid generating agent and a crosslinking agent.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-296780 (P2002-296780A)

(43)公開日 平成14年10月9日(2002.10.9)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	デーマコート*(参考)					
G03F 7/0	39 601	C 0 3 F 7/039	601 2H025					
C08K 5/0	0	C 0 8 K 5/00	2H096					
C08L 45/0	0	C 0 8 L 45/00	4 J 0 0 2					
65/0	0	65/00						
101/0	2	101/02						
	審查請	求 未請求 請求項の数3 OL	. (全 19 頁) 最終頁に続く					
(21)出顧番号	特顧2001-100586(P2001-100586)	(71)出顧人 000229117						
		日本ゼオン	朱式会社					
(22) 的顧日	平成13年3月30日(2001.3.30)	東京都千代日	田区丸の内2 5目6番1号					
		(72)発明者 小出村 順	a j					
		神奈川県川崎	商市川崎区夜光一丁目2番1号					
		日本ゼオン	ン株式会社総合開発センター内					
		(72)発明者 川原 耕平						
		神奈川県川崎	商市川崎区夜光一丁目2番1号					
		日本ゼオン	ン株式会社総合開発センター内					
		(74)代理人 10009/180						
	·	弁理士 前田	日均(外2名)					
			最終頁に続く					

(54) 【発明の名称】 威光性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 平坦性、耐熱性、透明性、耐薬品性等の諸性能に優れるとともに、脱ガス性が良く、低誘電性に優れ、微細なパターン状硬化膜を容易に形成することができる感光性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 環状オレフィン系重合体と、溶解制御剤と、光酸発生剤と、架橋剤とを含有する感光性樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 環状オレフィン系重合体と、溶解制御剤と、光酸発生剤と、架橋剤とを含有する感光性樹脂組成物。

【請求項2】 重合性不飽和基を含有する環状オレフィン系重合体と、溶解制御剤と、光酸発生剤とを含有する感光性樹脂組成物。

【請求項3】 請求項1又は2記載の感光性樹脂組成物 を架橋してなる硬化膜を有する電子部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光性樹脂組成物に関する。さらに詳しくは、電子部品に用いられる保護膜等を形成するための材料、または層間絶縁膜、特に、液晶表示素子、集積回路素子、固体撮像素子等の層間絶縁膜を形成するための材料として好適な低誘電性の感光性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示素子、集積回路素子、固体撮像 素子等の電子部品や、液晶ディスプレー用カラーフィル ターなどには、その劣化や損傷を防止するための保護 膜、累子表面や配線を平坦化するための平坦化膜、電気 絶縁性を保つための絶縁膜等が設けられている。また、 薄膜トランジスタ型液晶表示素子や集積回路素子には、 層状に配置される配線の間を絶縁するために層間絶縁膜 が設けられている。しかし、従来知られている電子部品 用の絶縁膜形成用の熱硬化性材料を用いて、例えば層間 絶縁膜を形成する場合には、必要とするパターン形状の 層間絶縁膜を得るための工程数が多く、しかも十分な平 坦性を有する層間絶縁膜が得られないという問題がある ため、微細なパターニングが可能な新しい感光性絶縁膜 形成材料の開発が求められてきた。また、近年、配線や デバイスの高密度化にともない、これらの材料に低誘電 性が求められるようになってきた。

【0003】このような要求に対応して、エステル基含有のノルボルネン系単量体を開環重合し、水素添加した後、エステル基部分を加水分解して得られるアルカリ可溶性環状オレフィン重合体と、キノンジアジド化合物と、メチロールメラミン等の架橋剤とを含有する組成物が提案された(特開平10-307388号公報)。しかし、この組成物による被膜は電気特性に優れるものの、加熱時に変色及びガス生成が起きて透明性及び密着性に欠けることがあった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、平坦性、耐熱性、低誘電性、耐薬品性等の諸性能のバランスに優れるとともに、脱ガス性が良く、密着性及び透明性に優れ、微細なパターン状硬化膜を容易に形成することができるポジ型感光性樹脂組成物を提供することにある。本発明者らは、上記目的を達成するべく検討した結

果、環状オレフィン系重合体と、それのアルカリ水性液に対する溶解性を制御する溶解制御剤と、光酸発生剤とを有し、架橋体を形成し得る組成物を用いることによって、本発明の目的を達成できることを見出し、この知見に基づいて本発明を完成するに到った。

[0005]

【課題を解決するための手段】かくして本発明によれば、(1)環状オレフィン系重合体と、溶解制御剤と、光酸発生剤と、架橋剤とを含有する感光性樹脂組成物(第一発明組成物)、(2)重合性不飽和基を含有する環状オレフィン系重合体と、溶解制御剤と、光酸発生剤とを含有する感光性樹脂組成物(第二発明組成物)、及び、(3)上記(1)又は(2)記載の感光性樹脂組成物を架橋してなる硬化膜を有する電子部品、が提供される。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明(上記第一発明又は第二発 明及びこれらを用いてなる硬化膜を有する電子部品の発 明)で使用する環状オレフィン系重合体は、脂環式構造 を有するオレフィン(以下、「環状オレフィン」という ことがある。)由来の繰り返し単位を含有する重合体で ある。脂環式構造としては、シクロアルカン構造やシク ロアルケン構造などが挙げられるが、機械的強度、耐熱 性などの観点から、シクロアルカン構造、殊にノルボル ナン構造が好ましい。また、脂環式構造としては、単環 及び多環(縮合多環、橋架け環、これらの組み合わせ多 環など)が挙げられる。脂環式構造を構成する炭素原子 数は、格別な制限はないが、通常4~30個、好ましく は5~20個、より好ましくは5~15個の範囲である ときに、機械的強度、耐熱性、及び成形性の諸特性が高 度にバランスされ好適である。また、本発明で使用され る環状オレフィン系重合体は、通常、熱可塑性のもので ある。

【0007】環状オレフィン系重合体中の環状オレフィン由来の繰り返し単位の割合は、使用目的に応じて適宜選択されるが、通常30~100重量%、好ましくは50~100重量%、より好ましくは70~100重量%である。環状オレフィン由来の繰り返し単位の割合が過度に少ないと、耐熱性に劣り好ましくない。

【0008】環状オレフィン系重合体は、通常、環状オレフィンを付加重合又は開環重合し、必要に応じて不飽和結合部分を水素化することによって得られる。或いは、環状オレフィン系重合体は、芳香族オレフィンを付加重合し、該重合体の芳香環部分を水素化することによって得られる。

【0009】環状オレフィン系重合体を得るために使用される環状オレフィンとしては、ビシクロ〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン(慣用名:ノルボルネン)、5ーメチルービシクロ〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン、5,5ージメチルービシクロ〔2.2.1〕ーヘプ

トー2ーエン、5ーエチルービシクロ〔2.2.1〕ー ヘプトー2ーエン、5ーブチルービシクロ〔2.2. 1〕ーヘプトー2ーエン、5ーヘキシルービシクロ 〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン、5ーオクチルービシクロ〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン、5ーオクタデシルービシクロ〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン、5ーエチリデンービシクロ〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン、5ーメチリデンービシクロ〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン、5ービニルービシクロ〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン、5ービニルービシクロ〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン、

【0010】5ープロペニルービシクロ〔2.2.1〕 ーヘプトー2ーエン、5ーメトキシーカルビニルービシ クロ〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン、5ーシアノー ビシクロ〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン、5ーメチ ルー5ーメトキシカルボニルービシクロ〔2.2.1〕 ーヘプトー2ーエン、5ーエトキシカルボニルービシク ロ〔2.2.1〕ーヘプトー2ーエン、ビシクロ〔2. 2.1〕ーヘプトー5ーエニルー2ーメチルプロピオネ イト、ビシクロ〔2.2.1〕ーヘプトー5ーエニルー 2ーメチルオクタネイト、

【0011】ビシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエンー5,6ージカルボン酸無水物、5-ヒドロキシメチルビシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2-エン、5,6ージ(ヒドロキシメチル)ービシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエン、5-ヒドロキシーi-プロピルビシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエン、5,6ージカルボキシービシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエン、5,6ージカルボン酸イミド、5-シクロペンチルービシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエン、5-シクロペンチルービシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエン、5-シクロへキセニルービシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエン、5-シクロへキセニルービシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエン、5-フェニルービシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエン、5-フェニルービシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエン、5-フェニルービシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエン、5-フェニルービシクロ〔2.2.1〕ーへプトー2ーエン、

【0012】トリシクロ〔4.3.0.12.5〕デカー3,7ージエン(慣用名:ジシクロペンタジエン)、トリシクロ〔4.3.0.12.5〕デカー3ーエン、トリシクロ〔4.4.0.12.5〕ウンデカー3,7ージエン、トリシクロ〔4.4.0.12.5〕ウンデカー3,8ージエン、トリシクロ〔4.4.0.12.5〕ウンデカー3ーエン、テトラシクロ〔7.4.0.110.13 .02.7〕ートリデカー2,4,6ー11ーテトラエン(別名:1,4ーメタノー1,4,4a,9aーテトラヒドロフルオレン)、テトラシクロ〔8.4.0.111.14 .02.8〕ーテトラデカー3,5,7,12ー11ーテトラエン(別名:1,4ーメタノー1,4,4a,5,10,10aーへキサヒドロアントラセン)、

【0013】テトラシクロ〔4.4.0.12.5 .

17.10 〕ードデカー3-エン(慣用名:テトラシク ロドデセン)、8~メチルーテトラシクロ〔4.4. 0.12.5 .17.10) - ドデカー3-エン、8 7.10]ードデカー3ーエン、8ーメチリデンーテト ラシクロ [4.4.0.12.5 .17.10] -ド デカー3-エン、8-エチリデンーテトラシクロ〔4. ン、8-ビニルーテトラシクロ〔4.4.0.1 2.5 . 17.10]ードデカー3ーエン、8ープロ ペニルーテトラシクロ〔4.4.0.12.5 .1 7・10]ードデカー3ーエン、8ーメトキシカルボニ ν -テトラシクロ $(4.4.0.1^{2.5}.1)$ 7・10]ードデカー3ーエン、8ーメチルー8ーメト キシカルボニルーテトラシクロ〔4.4.0.1 2.5 . 17.10] -ドデカー3-エン、8-ヒド ロキシメチルーテトラシクロ〔4.4.0.12,5. 17·10]ードデカー3ーエン、8ーカルボキシーテ トラシクロ [4.4.0.12,5 .17,10] -ドデカー3ーエン、

【0014】 $8-\nu \rho D^{2} \nabla^{2} \nabla^{2$

【0015】5-フェニルビシクロ〔2.2.1〕ヘプ トー2-エン、テトラシクロ〔6.5.0. 12.5 . 08.13]トリデカー3,8,10,1 2-r+jx+(1, 4-x+j+1, 4, 4a, 9a)ーテトラヒドロフルオレンともいう)、テトラシクロ $[6.6.0.1^{2.5}.1^{8.13}]$ テトラデカー 3,8,10,12ーテトラエン(1,4ーメタノー 1, 4, 4a, 5, 10, 10a-ヘキサヒドロアント ラセンともいう)のごときノルボルネン系単量体: 【0016】シクロブテン、シクロペンテン、シクロへ キセン、3,4ージメチルシクロペンテン、3ーメチル シクロヘキセン、2-(2-メチルブチル)-1-シク ロヘキセン、シクロオクテン、3a, 5, 6, 7a-テ トラヒドロー4, 7ーメタノー1Hーインデン、シクロ ヘプテンのごとき単環のシクロアルケン;ビニルシクロ ヘキセンやビニルシクロヘキサンのごときビニル系脂環 式炭化水素系単量体;シクロペンタジエン、シクロヘキ サジエンのごとき脂環式共役ジエン系モノマー;などが 挙げられる。

【0017】 芳香族オレフィンとしては、スチレン、αーメチルスチレン、ジビニルベンゼン、ビニルナフタレン、ビニルトルエンなどが挙げられる。

【0018】環状オレフィン及び/又は芳香族オレフィ ンは、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせ て用いることができる。環状オレフィン系重合体は、前 記環状オレフィン及び/又は芳香族オレフィンと、これ らと共重合可能な単量体とを共重合して得られるもので あってもよい。環状オレフィン又は芳香族オレフィンと 共重合可能な単量体としては、エチレン、プロピレン、 **1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、3-メチル** -1-ブテン、3-メチル-1-ペンテン、3-エチル -1-ペンテン、4-メチル-1-ペンテン、4-メチ ルー1-ヘキセン、4,4-ジメチル-1-ヘキセン、 4,4-ジメチル-1-ペンテン、4-エチル-1-ヘ キセン、3-エチル-1-ヘキセン、1-オクテン、1 ーデセン、1ードデセン、1ーテトラデセン、1ーヘキ サデセン、1-オクタデセン、1-エイコセンなどの炭 素数2~20のエチレンまたは α -オレフィン;1,4 **-ヘキサジエン、4-メチル-1,4-ヘキサジエン、** 5-メチル-1, 4-ヘキサジエン、1, 7-オクタジ エンなどの非共役ジエン;等が挙げられる。これらの単 量体は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わ せて使用することができる。なお、αーオレフィンに は、環状オレフィンの開環共重合に使用されると分子量 調整剤として機能するものもある。

【0019】環状オレフィン又は/及び芳香族オレフィ ンの重合方法及び必要に応じて行われる水素添加の方法 は、格別な制限はなく、公知の方法に従って行うことが できる。環状オレフィン系重合体としては、例えば、ノ ルボルネン系単量体の開環重合体及びその水素添加物、 ノルボルネン系単量体の付加重合体、ノルボルネン系単 量体とビニル化合物との付加重合体、単環シクロアルケ ン重合体、脂環式共役ジエン重合体、ビニル系脂環式炭 化水素重合体及びその水素添加物、芳香族オレフィン重 合体の芳香環水素添加物などが挙げられる。これらの中 でも、ノルボルネン系単量体の開環重合体及びその水素 添加物、ノルボルネン系単量体の付加重合体、ノルボル ネン系単量体とビニル化合物との付加重合体、芳香族オ レフィン重合体の芳香環水素添加物が好ましく、特にノ ルボルネン系単量体の開環重合体の水素添加物が好まし い。前記の環状オレフィン系重合体は、それぞれ単独 で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができ る。

【0020】本発明で使用する環状オレフィン系重合体は、アルカリ水性液に対して可溶性であっても、不溶性であってもよい。環状オレフィン系重合体がアルカリ可溶性である場合は、少なくとも極性基を含有することが好ましい。かかる極性基としては、ヒドロキシル基、カ

ルボキシル基、アルコキシル基、エボキシ基、グリシジル基、オキシカルボニル基、カルボニル基、アミド基、エステル基、酸無水物基などが挙げられる。これらの極性基のなかでも、カルボキシル基、エステル基、アミド基、酸無水物基、ヒドロキシル基などの酸性基又は酸誘導体型残基が好ましい。

【0021】環状オレフィン系重合体に極性基を導入するためには、例えば、該官能基を有する単量体を(共) 重合成分として(共)重合することによって、又は、前記の単量体を重合して得られた環状オレフィン系重合体に極性基含有化合物を変性反応によってグラフト変性することによって行うことができる。本発明においては後者の変性反応によって得られるものが好適である。

【0022】極性基を有する化合物の具体例としては、アクリル酸、メタクリル酸、αーエチルアクリル酸、2ーヒドロキシエチル(メタ)アクリル酸、マレイン酸、フマール酸、イタコン酸、エンドシスービシクロ[2.2.1]へプトー5ーエンー2,3ージカルボン酸、メチルーエンドシスービシクロ[2.2.1]へプトー5ーエンー2,3ージカルボン酸などの不飽和カルボン酸化合物及びこれらのエステル又はアミド;無水マレイン酸、クロロ無水マレイン酸、ブテニル無水コハク酸、テトラヒドロ無水フタル酸、無水シトラコン酸などの不飽和カルボン酸無水物などが挙げられる。

【0023】環状オレフィン系重合体と極性基を有する 化合物との変性反応は、公知の方法によって行うことが できる。該変性反応は、通常、ラジカル開始剤の存在下 に環状オレフィン系重合体と極性基を有する化合物とを 共存させることにより行う。ラジカル開始剤としては、 ベンゾイルペルオキシド、ジクロルベンゾイルペルオキ シド、ジクミルペルオキシド、ジーtert-ブチルペ ルオキシド、ラウロイルペルオキシド、tert-ブチ ルペルアセテート、tert‐ブチルペルベンゾエー ト、tert-ブチルベルフェニルアセテート、ter tーブチルペルイソブチレート、tertーブチルペル ーsec-オクトエート、tert-ブチルペルピパレ ート、クミルペルピパレート、tert-ブチルペルジ エチルアセテートなどを挙げることができる。また、ア ゾビスイソブチロニトリル、ジメチルアゾイソブチレー トなどのアゾ化合物を挙げることができる。これらラジ カル開始剤のうち有機ペルオキシド、有機ペルエステル などが好適に使用される。これらのラジカル開始剤は、 それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用い ることができる。ラジカル開始剤の使用割合は、環状オ レフィン系重合体100重量部に対して通常0.001 ~50重量部、好ましくは0.01~40重量部、より 好ましくは0.1~30重量部の範囲である。

【0024】変性反応の条件は、特に限定されず、例えば、反応温度は、通常0~400℃、好ましくは60~300℃、より好ましくは80~200℃で、反応時間

は、通常1分~24時間、好ましくは30分~10時間の範囲である。変性率は、重合体がアルカリ可溶性を呈する程度にすることが好ましい。アルカリ可溶性を呈するためには、重合体中の総単量体単位数を基準として、通常10~200モル%、好ましくは30~150モル%、より好ましくは50~100モル%、特に好ましくは60~80モル%の範囲である。変性率がこの範囲にあるときに、低誘電性、透明性、耐熱性、耐溶剤性、現像性及び表面硬度特性等の特性が高度にバランスされ好適である。

【0025】変性率は、変性率=X×100(%)で表される値であり、 1 H-NMR測定に基づき算出することができる。すなわち、 1 H-NMR測定データから極性基含有不飽和化合物由来の水素のピーク面積の総和Aと、環状オレフィン系重合体がラフト変性物中の環状オレフィン系重合体由来の水素のピーク面積の総和Bをそれぞれ求める。重合体変性反応で反応した極性基含有不飽和化合物1分子が有する水素原子数をC、環状オレフィン系重合体の単量体1単位が有する水素原子をDとすると、

$(D-X)/(C\times X) = B/A$

の関係がある。この式から変性率X(%)を知ることができる。例えば、極性基含有不飽和化合物が無水マレイン酸の場合は、Cは3であり、環状オレフィン系重合体がエチルテトラドデセン開環重合体水素化物の場合は、Dは22である。

【0026】本発明に使用される環状オレフィン系重合 体が、酸無水物基を有する化合物又はエステル基を有す る化合物を環状オレフィン系重合体に変性させたもので ある場合には、変性反応で導入された酸無水物基又はエ ステル基を加水分解又はアミド化することが好ましい。 加水分解又はアミド化するために使用する化合物とし て、水;メチルアミン、エチルアミン、ブチルアミン、 ペンチルアミン、アリルアミン、ジアリルアミン、ビニ ルアミン;ジメチルアミン、ジプロピルアミンのごとき アミン;などが挙げられる。これらのうち、第一級アミ ン、殊に不飽和炭素-炭素結合を有する第一級アミンが 好ましい。また、加水分解又はアミド化を促進させるた めに使用する化合物として、水酸化カリウム、水酸化ナ トリウム ; トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリ ブチルアミン:トリフェニルホスフィン等が挙げられ る。これらのうち、金属水酸化物が好ましい。

【0027】本第二発明組成物において使用される重合性不飽和基を含有する環状オレフィン系重合体における、重合性不飽和基の代表例としては、炭素 – 炭素不飽和二重結合を有する官能基が挙げられる。具体的には、ビニル基、アリル基、アクリロイル基、メタクリロイル基などが挙げられる。これらの重合性不飽和基を環状オレフィン系重合体に含有させる方法としては、例えば、重合性不飽和基を有する単量体を(共)重合成分として

(共)重合する方法、又は、前記の単量体を重合して得られた環状オレフィン系重合体に、重合性不飽和基含有化合物を変性反応によって付加する方法が挙げられる。本第二発明組成物においては後者の変性反応による方法が好適である。変性反応で重合性不飽和基を含有させるためには、環状オレフィン系重合体として、酸性基又は酸誘導体型残基を有するものを用いることが好ましい。酸性基又は酸誘導体型残基があることによって重合性不飽和基を有する化合物が変性反応しやすくなる。

【0028】変性反応に用いられる重合性不飽和基含有 化合物としては、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリ レート、2ーヒドロキシプロピル(メタ)アクリレー **ト、2-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、2-**ヒドロキシー3-フェノキシプロピル(メタ)アクリレ ート、グリセドールジ (メタ) アクリレート、3-アク リロイロキシー2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリ レート、2-アクリロイロキシエチルフタル酸、2-ア クリロイロキシエチルコハク酸、2-アクリロイロキシ エチルー2-ヒドロキシエチルーフタル酸、2-アクリ ロイロキシエチルヘキサヒドロフタル酸、ペンタエリス リトールジ(メタ)アクリレートモノステアレート、ペ ンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレートのごとき ヒドロキシル基を有する(メタ)アクリレート類;p-アミノ安息香酸(メタ)アクリロイルエタノールエステ ル、p-アミノ安息香酸トリス(メタ)アクリロイルペ ンタエリスリトールエステルのごときアミノ基を有する (メタ)アクリレート類;グリシジル(メタ)アクリレ ート、シクロヘキセンオキサイド(メタ)アクリレート (ダイセル社製 M-100、A200)のごときエポ キシ基を有する(メタ)アクリレート類;などの(メ **タ)アクリレート:**

【0029】エチレングリコールビニルエーテルのごと きヒドロキシル基を有するビニルエーテル類:グリシジ ルビニルエーテル、グリシジルビニルベンジルエーテル のごときエポキシ基を有するビニルエーテル類;アリル グリシジルエーテル ; ビニルフェノールのごときヒドロ キシル基を有するビニル化合物類;4-ビニル-1-シ クロヘキセンー1、2-エポキシドのごときエポキシ基 を有するビニル化合物類:4-ビニルアニリンのごとき アミノ基を有するビニル類;アリルアルコール、アリル フェノールのごときヒドロキシル基を有するアリル化合 物類;アリルグリシジルエーテルのごときエポキシ基を 有するアリル化合物類;アリルアミン、アリルアニリン のごときアミノ基を有するアリル化合物類: などが挙げ られる。重合性不飽和基を有する化合物による変性反応 は、公知の方法によって行うことができる。該変性反応 は、通常、乾燥した溶媒中で反応温度0~100℃、好 ましくは25~80℃の範囲で行う。また、反応促進の ためにアミン系又はリン系の触媒を用いることができ る。さらにゲル化を抑制するために重合禁止剤(ハイド

ロキノン類等)を添加することもできる。

【0030】本発明組成物に使用される環状オレフィン系重合体の分子量は、使用目的に応じて適宜選択されるが、トルエン、テトラヒドロフラン(THF)、クロロホルム、ジメチルアセトアミドなどを溶媒とするゲルバーミエーションクロマトグラフィー(GPC)で測定されるポリスチレン換算の重量平均分子量(Mw)で、通常3、000~500、000、好ましくは5、000~100、000、より好ましくは7、000~50、000の範囲である。環状オレフィン系重合体の重量平均分子量(Mw)がこの範囲にあるときに、現像性、平均分子量(Mw)がこの範囲にあるときに、現像性、平均分子量(Mw)がこの範囲にあるときに、現像性、平均分子量(Mw)がこの範囲にあるとさいが、通常50℃以上、好ましくは80℃以上、より好ましくは100℃以上であるときに耐熱性に優れ好適である。

【0031】本発明で用いる溶解制御剤は、環状オレフ ィン系重合体のアルカリ水性液に対する溶解性を制御す る性質を有する。溶解制御剤は酸解離性基を有する疎水 性の物質であるが、後述の光酸発生剤が酸を生成するこ とにより、酸解離性基が解離して親水性に変じる。溶解 制御剤は、疎水性の物質である間は環状オレフィン系重 合体のアルカリ水性液に対する溶解性を抑止し、親水性 に変じると環状オレフィン系重合体の溶解性を促進す る。すなわち、当初、溶解制御剤は環状オレフィン系重 合体と混合された状態では、アルカリ水性液を寄せつけ ず、そのため溶解抑制剤として働く。一方、酸が供給さ れると溶解制御剤は親水性に変じてアルカリ水性液を呼 び込むので、環状オレフィン系重合体をアルカリ水性液 に分散させる作用を有する。このとき、環状オレフィン 系重合体がアルカリ可溶性極性基を有すると、容易にア ルカリ水性液に流出するので好ましい。このように、酸 の供給を受けると溶解制御剤は溶解促進剤として働く。 かかる溶解制御剤としては、例えば、フェノール性水酸 基、カルボキシル基等の酸性官能基に、酸の存在下で解 離しうる1種以上の基(以下、「酸解離性基」とい う。)を導入した化合物を挙げることができる。このよ うな酸解離性基としては、例えば、置換メチル基、1-置換エチル基、シリル基、1-分岐アルキル基、ゲルミ ル基、アルコキシカルボニル基、アシル基、環式酸解離 性基等の酸解離性基等を挙げることができる。

【0032】前記置換メチル基としては、例えば、メトキシメチル基、メチルチオメチル基、エトキシメチル基、メトキシエトキシメチル基、ベンジルオキシメチル基、ベンジルチオメチル基、フェナシル基、ブロモフェナシル基、メトキシフェナシル基、メチルチオフェナシル基、シクロプロピルメチル基、ベンジル基、ジフェニルメチル基、トリフェニルメチル基、ブロモベンジル基、エトロベンジル基、メトキシベンジル基、メチルチオベンジル基、エトキシベンジル基、エチルチオベンジ

ル基、ピペロニル基、メトキシカルボニルメチル基、エ トキシカルボニルメチル基等を挙げることができる。ま た、前記1-置換エチル基としては、例えば、1-メト キシエチル基、1-エトキシエチル基、1-メチルチオ エチル基、1-n-ブトキシエチル基、1,1-ジメト キシエチル基、1-フェノキシエチル基、1-フェニル チオエチル基、1,1-ジフェノキシエチル基、1-ベ ンジルオキシエチル基、1-ベンジルチオエチル基、1 ーシクロプロピルエチル基、1-フェニルエチル基、 1,1-ジフェニルエチル基、1-メトキシカルポニル エチル基、1-エトキシカルボニルエチル基等を挙げる ことができる。また、前記1-分岐アルキル基として は、例えば、イソプロピル基、セーブチル基、1,1-ジメチルプロピル基等を挙げることができる。また、前 記シリル基としては、例えば、トリメチルシリル基、エ チルジメチルシリル基、メチルジエチルシリル基、トリ エチルシリル基、イソプロピルジメチルシリル基、メチ ルジイソプロピルシリル基、トリイソプロピルシリル基 等を挙げることができる。また、前記ゲルミル基として は、例えば、トリメチルゲルミル基、エチルジメチルゲ ルミル基、メチルジエチルゲルミル基、トリエチルゲル ミル基、イソプロピルジメチルゲルミル基、フェニルジ メチルゲルミル基、メチルジフェニルゲルミル基等を挙 げることができる。

【0033】また、前記アルコキシカルボニル基として は、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニ ル基、イソプロポキシカルボニル基、t-ブトキシカル ボニル基等を挙げることができる。前記アシル基として は、例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル 基、ヘプタノイル基、ヘキサノイル基、バレリル基、ピ バロイル基、イソバレリル基、ラウリロイル基、ミリス トイル基、パルミトイル基、ステアロイル基、オキサリ ル基、マロニル基、スクシニル基、グルタリル基、アジ ポイル基、ピペロイル基、スペロイル基、アゼラオイル 基、セバコイル基、アクリロイル基、プロピオロイル 基、メタクリロイル基、クロトノイル基、オレオイル 基、マレオイル基、フマロイル基、メサコノイル基、カ ンホロイル基、ベンゾイル基、フタロイル基、テレフタ ロイル基、ナフトイル基、メシル基等を挙げることがで きる。前記環式酸解離性基としては、例えば、シクロプ ロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シク ロヘキセニル基、4-メトキシシクロヘキシル基等の脂 環式骨格を有する基のほか、テトラヒドロピラニル基、 メチルテトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル 基、メチルテトラヒドロフラニル基、テトラヒドロチオ フラニル基、3ープロモテトラヒドロピラニル基等を挙 げることができる。これらの酸解離性基のうち、1-メ トキシエチル基、1-エトキシエチル基、1-n-ブト キシエチル基、t-ブチル基、t-ブトキシカルボニル 基、テトラヒドロピラニル基、メチルテトラヒドロピラ

ニル基、テトラヒドロフラニル基、メチルテトラヒドロフラニル基等が好ましい。

【0034】溶解制御剤は、低分子化合物のものと高分子化合物のものとがある。溶解制御剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができ、また、低分子化合物と高分子化合物とを併用することもできる。本発

【0036】〔式(1)において、R1 は置換メチル基、1-置換エチル基、1-分岐アルキル基、シリル基、ゲルミル基、アルコキシカルボニル基、アシル基又は環式酸解離性基を示し、複数存在するR1 は相互に同一でも異なってもよく、R2は炭素数1~4のアルキル基、フェニル基または1-ナフチル基を示し、複数存

明においては高分子化合物からなる溶解制御剤が好ましい。低分子化合物の具体例としては、下記式(1)~(5)で表される化合物を挙げることができる。【0035】 【化1】

(1)

在するR² は相互に同一でも異なってもよく、pは1以上の整数、qは0以上の整数で、p+q≤6である。〕

【0037】 【化2】

$$\begin{pmatrix} R^{1}O \\ R^{2} \end{pmatrix}_{q} \qquad \qquad \begin{pmatrix} OR^{1} \\ R^{2} \end{pmatrix}_{s} \qquad \qquad (2)$$

【0038】〔式(2)において、R1 およびR2 は式(1)と同義であり、Dは単結合、-S-、-O-、-CO-、-COO-、-SO-、-SO₂ -、-CR₂-(但し、2つのRは相互に同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数1~6のアルキル基、炭素数2~11のアシル基、フェニル基又はナフチル基を示す。)又は、

[0039]

【化3】

【0040】(但し、 R^2 は前記に同じであり、xは 0~4の整数である。)を示し、p、q、r及びsはそれぞれ0以上の整数で、 $p+q \le 5$ 、 $r+s \le 5$ 、 $p+r \ge 1$ である。〕

[0041]

【化4】

$$\begin{pmatrix} R^{1}O \end{pmatrix}_{p} \begin{pmatrix} R^{2} \end{pmatrix}_{x} \begin{pmatrix} QR^{1} \end{pmatrix}_{r} \begin{pmatrix} QR^{1} \end{pmatrix}_{r} \begin{pmatrix} QR^{2} \end{pmatrix}_{a} \begin{pmatrix} QR^$$

【0042】〔式(3)において、 R^1 および R^2 は式(1)と同義であり、 R^5 は水素原子、炭素数1 ~4のアルキル基またはフェニル基を示し、p、q、

r、s、t及びuはそれぞれ0以上の整数で、 $p+q \le 5$ 、 $r+s \le 5$ 、 $t+u \le 5$ 、 $p+r+t \ge 1$ である。〕

[0043]

$$\begin{array}{c}
(R^{1}O)_{p} \\
(R^{2})_{q} \\
(R^{2})_{u}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(OR^{1})_{r} \\
(R^{2})_{u}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(A1) \\
(R^{2})_{u}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(A2)_{u}
\end{array}$$

【0044】〔式(4)において、 R^1 および R^2 は式(1)と同義であり、Dは式(2)と同義であり、 R^5 は式(3)と同義であり、複数存在する R^5 は相互に同一でも異なってもよく、p、q、r、s、t、u、v及びwはそれぞれ0以上の整数で、 $p+q \le 5$ 、

r+s≦5、t+u≦5、v+w≦5、p+r+t+v ≧1である。〕 【0045】 【化6】

$$\begin{pmatrix}
R^{10} \\
R^{2}
\end{pmatrix}_{q} \qquad \begin{pmatrix}
C \\
R^{2}
\end{pmatrix}_{w} \qquad (5)$$

$$\begin{pmatrix}
R^{10} \\
R^{10}
\end{pmatrix}_{v} \qquad \begin{pmatrix}
R^{2} \\
R^{2}
\end{pmatrix}_{w} \qquad (5)$$

【0046】〔式(5)において、 R^1 及び R^2 は式(1)と同義であり、 R^5 は式(3)と同義であり、複数存在する R^5 は相互に同一でも異なってもよく、p、q、r、s、t、u、v及びwはそれぞれ0以上の整数で、 $p+q \le 5$ 、 $r+s \le 5$ 、 $t+u \le 5$ 、 $v+w \le 4$ 、 $p+r+t+v \ge 1$ である。〕

【0047】また、高分子の溶解制御剤としては、例えば、酸解離性基含有樹脂を使用することができる。酸解離性基含有樹脂としては、例えば、下記酸解離性基含有樹脂(I)、酸解離性基含有樹脂(II)等を挙げることができる。酸解離性基含有樹脂(I)は、フェノール性水酸基、ナフトール性水酸基、カルボキシル基等の酸性官能基を1種以上含有するアルカリ可溶性樹脂中の該酸性官能基の水素原子を、1種以上の酸解離性基で置換

した構造を有する樹脂で、側鎖を有することもある直鎖 状重合体からなり、それ自体としてはアルカリ不溶性ま たはアルカリ難溶性の樹脂である。ここで「アルカリ不 溶性またはアルカリ難溶性」とは、酸解離性基含有樹脂 を含有する感光性樹脂組成物を用いて絶縁性パターン被 膜を形成する際に採用されるアルカリ現像条件下で被膜 を現像した場合に、当該被膜の初期膜厚の50%以上が 現像後に残存する性質を意味する。酸解離性基含有樹脂 (II)は、主鎖に脂環式骨格を有するアルカリ不溶性 またはアルカリ難溶性の酸解離性基含有樹脂で、それ自 体としてはアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂 である。

【0048】酸解離性基含有樹脂(I)における酸解離性基(以下、「酸解離性基(i)」という。)として

は、上記した置換メチル基、1-置換エチル基、1-分 岐アルキル基、シリル基、ゲルミル基、アルコキシカル ボニル基、アシル基、環式酸解離性基等を挙げることが できる。酸解離性基含有樹脂(I)における酸解離性基 (i)の含有率(酸解離性基含有樹脂中の酸性官能基と 酸解離性基(i)との合計数に対する酸解離性基数の割 合)は、好ましくは5~100%、さらに好ましくは2 0~100%である。この場合、酸解離性基(i)の含 有率が小さすぎるとパターン解像度が低下するおそれが ある。

【0049】酸解離性基含有樹脂(I)の製造法として は、例えば、(イ)予め製造したアルカリ可溶性樹脂に 1種以上の酸解離性基(i)を導入する方法、(ロ)1 種以上の酸解離性基(i)を有する重合性不飽和化合物 を(共)重合する方法、(ハ)1種以上の酸解離性基 (i)を有する重縮合性成分を(共)重縮合する方法等 を挙げることができる。酸解離性基含有樹脂(I)の製 造法(イ)に使用されるアルカリ可溶性樹脂としては、 例えば、酸性官能基を有する繰返し単位を1種以上有す る付加重合系樹脂あるいは重縮合系樹脂を挙げることが できる。付加重合系のアルカリ可溶性樹脂における酸性 官能基を有する繰返し単位としては、例えば、o-ヒド ロキシスチレン、mーヒドロキシスチレン、pーヒドロ キシスチレン、ρーヒドロキシーαーメチルスチレン、 p-カルボキシスチレン、p-(2-カルボキシエチ ル) スチレン、p -カルボキシメトキシスチレン、p -(2-カルボキシエトキシ)スチレン、p-カルボキシ **メチルカルボニルオキシスチレン等の(α-メチル)ス** チレン誘導体;2-ヒドロキシ-1-ビニルナフタレ ン、7-ヒドロキシー1-ビニルナフタレン、3-ヒド ロキシー1ーイソプロペニルナフタレン、8ーヒドロキ シー1ーイソプロペニルナフタレン、4ーカルボキシー **1ービニルナフタレン、7ーカルボキシー1ービニルナ** フタレン等のビニルナフタレン誘導体あるいはイソプロ ペニルナフタレン誘導体:(メタ)アクリル酸、クロト ン酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン 酸、メサコン酸、けい皮酸等の不飽和カルボン酸類; (メタ)アクリル酸2-カルボキシエチル、(メタ)ア クリル酸2ーカルボキシプロピル、(メタ)アクリル酸 3-カルボキシプロピル、(メタ)アクリル酸4-カル ボキシブチル等のカルボキシル基含有不飽和カルボン酸 エステル類等の酸性官能基を有する重合性不飽和化合物 中の重合性不飽和結合が開裂した単位を挙げることがで きる。これらの繰返し単位のうち、p-ヒドロキシスチ

【0050】付加重合系のアルカリ可溶性樹脂は、酸性官能基を有する繰返し単位のみから構成されていてもよいが、得られる樹脂がアルカリ可溶性である限り、他の

レン、pーヒドロキシーαーメチルスチレン、pーカル

ボキシスチレン、(メタ)アクリル酸等の重合性不飽和

結合が開裂した単位が好ましい。

重合性不飽和化合物の重合性不飽和結合が開裂した繰返し単位を1種以上含有することができる。前記他の重合性不飽和化合物としては、例えば、スチレン、αーメチルスチレン、4ーtーブチルスチレン、1ービニルナフタレン、4ーメチルー1ービニルナフタレン、1ーイソアロペニルナフタレン、4ークロロー1ービニルナフタレン、5ーメトキシー1ービニルナフタレン等のビニル芳香族化合物:(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸ロープロピル、(メタ)アクリル酸2ーヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸イソボルニル、(メタ)アクリル酸イソボルニル、(メタ)アクリル酸イソボルニル、(メタ)アクリル酸シクロペンテニル、(メタ)アクリル酸アダマンチル等の(メタ)アクリル酸エステル類;

【0051】酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビ ニル等のビニルエステル類;(メタ)アクリロニトリ ル、αークロロアクリロニトリル、クロトンニトリル、 マレインニトリル、フマロニトリル等の不飽和ニトリル 化合物;(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチル (メタ)アクリルアミド、メサコンアミド、シトラコン アミド等の不飽和アミド化合物;Nービニルーεーカプ ロラクタム、N-ビニルピロリドン、ビニルピリジン、 ビニルイミダゾール等の他の含窒素ビニル化合物等を挙 げることができる。これらの他の重合性不飽和化合物の **うち、スチレン、α-メチルスチレン、(メタ)アクリ** ル酸メチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチ ル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシプロピルや、 (メタ)アクリル酸イソボルニル、(メタ)アクリル酸 トリシクロデカニル、(メタ)アクリル酸ジシクロペン テニル、(メタ)アクリル酸アダマンチル等のエステル 基中に脂環式骨格を有する(メタ)アクリル酸エステル 類等が好ましい。

【0052】また、前記重縮合系のアルカリ可溶性樹脂 は、1種以上のフェノール類と1種以上のアルデヒド類 とを、場合により他の繰返し単位を形成しうる重縮合成 分とともに、酸性触媒の存在下、水媒質中または水と親 水性溶媒との混合の水性液中で重縮合することによって 製造することができる。前記フェノール類としては、例 えば、フェノール、ロークレゾール、ロークレゾール、 2, 3-+2ーキシレノール、2,3,5ートリメチルフェノール、 レゾルシノール、カテコール、ピロガロール、1-ナフ トール、2-ナフトール等を挙げることができ、また前 記アルデヒド類としては、例えば、ホルムアルデヒド、 トリオキサン、パラホルムアルデヒド、ベンズアルデヒ ド、アセトアルデヒド、プロピルアルデヒド、フェニル アセトアルデヒド等を挙げることができる。付加重合系 および重縮合系のアルカリ可溶性樹脂における酸性官能 基を有する繰返し単位の含有率は、該繰返し単位および

他の繰返し単位の種類により一概に規定できないが、通常、10~100モル%、好ましくは15~100モル%である。

【0053】酸解離性基含有樹脂(i)の製造法(ロ) に使用される、酸解離性基(i)を有する重合性不飽和 化合物としては、例えば、前記(イ)の方法で例示した 酸性官能基を有する重合性不飽和化合物中の該酸性官能 基の水素原子を、酸解離性基(i)で置換した化合物を 挙げることができ、また、酸解離性基含有樹脂(Ⅰ)の 製造法(ハ)に使用される酸解離性基(i)を有する重 縮合性成分としては、例えば、前記酸解離性基含有樹脂 (I) の製造法(イ)で例示したフェノール類のフェノ ール性水酸基の水素原子を酸解離性基(i)で置換した 化合物とアルデヒド類とを挙げることができる。製造法 (ロ)あるいは製造法(ハ)においても、酸解離性基 (i)を有する重合性不飽和化合物あるいは酸解離性基 (i)を有する重縮合性成分以外に、他の重合性不飽和 化合物あるいは他の重縮合性成分を、通常、60重量% 以下、好ましくは50重量%以下の量で使用することも できる。酸解離性基含有樹脂(Ⅰ)の製造法(イ)にお ける付加重合系のアルカリ可溶性樹脂を製造する際の重 合、および、同製造法(ロ)における重合は、例えば、 ラジカル重合開始剤、アニオン重合触媒、配位アニオン 重合触媒、カチオン重合触媒等を適宜に選定し、塊状重 合、溶液重合、沈澱重合、乳化重合、懸濁重合、塊状-懸濁重合等の適宜の重合方法により実施することができ る。

【0054】酸解離性基含有樹脂(I)の具体例としては、4-t-ブトキシスチレン/4-ヒドロキシスチレン共重合体、4-t-ブトキシカルボニルオキシスチレン/4-ヒドロキシスチレン共重合体、4-(1-エトキシエトキシ)スチレン/4-ヒドロキシスチレン共重合体、4-(1-n-ブトキシエトキシ)スチレン/4-ヒドロキシスチレン/4-ヒドロキシスチレン共重合体、4-ナトラヒドロピラニルオキシスチレン/4-ヒドロキシー1-ビニルナフタレン/4-ヒドロキシー1-ビニルナフタレン共重合体、4-t-ブトキシカルボニルオキシー1-ビニルナフタレン/4-ヒドロキシー1-ビニルナフタレン共重合体等のビニルナフタレン系樹脂;

【0055】(メタ)アクリル酸セーブチル/(メタ)アクリル酸メチル共重合体、(メタ)アクリル酸セーブチル/(メタ)アクリル酸トリシクロデカニル/(メタ)アクリル酸共重合体、(メタ)アクリル酸セーブトキシカルボニル/(メタ)アクリル酸トリシクロデカニル/(メタ)アクリル酸共重合体、(メタ)アクリル酸

テトラヒドロピラニル/ (メタ) アクリル酸トリシクロデカニル/ (メタ) アクリル酸共重合体、(メタ) アクリル酸メチルテトラヒドロフラニル/ (メタ) アクリル酸トリシクロデカニル/ (メタ) アクリル酸共重合体、(メタ) アクリル酸 t ーブチル/ (メタ) アクリル酸 2 ーヒドロキシプロピル共重合体、(メタ) アクリル酸 2 ーヒドロキシカルボニル/ (メタ) アクリル酸 2 ーヒドロキシプロピル共重合体、(メタ) アクリル酸テトラヒドロピラニル/ (メタ) アクリル酸テトラヒドロピラニル/ (メタ) アクリル酸 2 ーヒドロキシプロピル共重合体、等の(メタ) アクリル系 樹脂等が挙げられる。

【0056】次に、酸解離性基含有樹脂(II)における脂環式骨格としては、例えば、シクロアルカン類に由来する骨格のように単環でも、ビシクロ[2.2.1] ヘプタン、テトラシクロ[4.4.0.12・5 .1 7・10]ドデカン等に由来する骨格のように多環でもよい。酸解離性基含有樹脂(II)における酸解離性基は、適宜の位置に存在することができるが、前記脂環式骨格は、適宜の位置に存在することができるが、前記脂環式骨格は、酸解離性基以外の置換基、例えば、ハロゲン原子、炭素数1~10の炭化水素基、炭素数1~10のハロゲン化炭化水素基等を1種以上有することもできる。酸解離性基含有樹脂(II)としては、前記環状オレフィンとして挙げた中のノルボルネン系単量体由来の繰返し単位を1種以上有する樹脂が好ましい。

【0057】ノルボルネン系単量体由来の繰り返し単位における酸解離性基(以下、「酸解離性基(ii)」という。)としては、一R6 COOR7 、一R6 OCOR8 もしくは一R6 CN {但し、R6 は一(CH2) っを示す。iは0~4の整数であり、R7 は炭素数1~10の炭化水素基、炭素数1~10のハロゲン化炭化水素基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、カルボブトキシズチル基、カルボブトキシズチル基、カルボブトキシプロピル基もしくはトリアルキルシリル基(但し、アルキル基の炭素数は1~4である。)を示す。R8 は炭素数1~10の炭化水素基を示す。}、または脂環式骨格中の炭素原子と結合して形成した、下式で表される含酸素複素環構造あるいは含窒素複素環構造が好ましい。

【0058】 【化7】

【0059】 {但し、R9 は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~8のアルキル基もしくは炭素数1~4の $-SO_2$ R^{10} (但し、 R^{10} は炭素数1~4のアルキル基もしくは炭素数1~4のハロゲン化アルキル基である。) を示す。}

【0060】酸解離性基(i i)において、-R6 C OOR⁷ としては、例えば、メトキシカルボニル基、 tーブトキシカルボニル基、nープロポキシカルボニル 基、i-プロポキシカルボニル基、n-ブトキシカルボ ニル基、2-メチルプロポキシカルボニル基、1-メチ ルプロポキシカルボニル基、t-ブトキシカルボニル 基、nーデシルオキシカルボニル基、シクロペンチルオ キシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル 基、4-t-ブチルシクロヘキシルオキシカルボニル基 等の(シクロ)アルコキシカルボニル基:フェノキシカ ルボニル基、4-t-ブチルフェノキシカルボニル基、 1-ナフチルオキシカルボニル基等のアリーロキシカル ボニル基;ベンジルオキシカルボニル基、4-t-ブチ ルベンジルオキシカルボニル基等のアラルキルオキシカ ルボニル基; テトラヒドロピラニルオキシカルボニル 基;

【0061】メトキシカルボニルメチル基、イソプロポ キシカルボニルメチル基、2-メチルプロポキシカルボ ニルメチル基、t-ブトキシカルボニルメチル基、シク ロヘキシルオキシカルボニルメチル基、4-t-ブチル シクロヘキシルオキシカルボニルメチル基等の(シク ロ) アルコキシカルボニルメチル基: フェノキシカルボ ニルメチル基、1-ナフチルオキシカルボニルメチル基 等のアリーロキシカルボニルメチル基:ベンジルオキシ カルボニルメチル基、4-t-ブチルベンジルオキシカ ルボニルメチル基等のアラルキルオキシカルボニルメチ ル基;2-メトキシカルボニルエチル基、2-エトキシ カルボニルエチル基、2-n-プロポキシカルボニルエ チル基、2-(2-メチルプロポキシ)カルボニルエチ ル基、2-(1-メチルプロポキシ)カルボニルエチル 基等の(シクロ)アルコキシカルボニルエチル基;2-フェノキシカルボニルエチル基、2-(1-ナフチルオ キシカルボニル)エチル基等の2-アリーロキシカルボ ニルエチル基:2-ベンジルオキシカルボニルエチル 基、2-(4-t-ブチルベンジルオキシカルボニル) エチル基等の2-アラルキルオキシカルボニルエチル基 等を挙げることができる。

【0062】また、-R6 OCOR8 としては、例 えば、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、バレ リルオキシ基、カプロイルオキシ基、オクタノイルオキ

シ基、デカノイルオキシ基、ウンデカノイルオキシ基、 シクロヘキシルカルボニルオキシ基、4-t-ブチルシ クロヘキシルカルボニルオキシ基等の(シクロ)アシロ キシ基:ベンゾイルオキシ基、4-t-ブチルベンゾイ ルオキシ基、1-ナフトイルオキシ基等のアリールカル ボニルオキシ基;ベンジルカルボニルオキシ基、4-t ーブチルベンジルカルボニルオキシ基等のアラルキルカ ルポニルオキシ基:アセチルオキシカルボニルメチル 基、プロピオニルオキシカルボニルメチル基、ブチリル オキシカルボニルメチル基、シクロヘキシルカルボニル オキシメチル基、4-t-ブチルシクロヘキシルカルボ ニルオキシメチル基等の(シクロ)アシロキシメチル 基:ベンゾイルオキシメチル基、1-ナフトイルオキシ メチル基等のアリールカルポニルオキシメチル基 : ベン ジルカルボニルオキシメチル基、4-t-ブチルベンジ ルカルボニルオキシメチル基等のアラルキルカルボニル オキシメチル基;2-アセチルオキシエチル基、2-ブ チリルオキシエチル基、2-シクロヘキシルカルボニル オキシエチル基、2-(4-t-ブチルシクロヘキシル カルボニルオキシ)エチル基等の2-(シクロ)アシロ キシエチル基;2-ベンゾイルオキシエチル基、2-(1-ナフトイルオキシ)エチル基等の2-アリールカ ルボニルオキシエチル基:2-ベンジルカルボニルオキ シエチル基、2-(4-t-ブチルベンジルカルボニル オキシ) エチル基等の2-アラルキルカルボニルオキシ エチル基等を挙げることができる。また、-R6 CN としては、例えば、シアノ基、シアノメチル基、2-シ アノエチル基、2-シアノプロピル基、3-シアノプロ ピル基、4-シアノブチル基等を挙げることができる。 これらの酸解離性基(ii)のうち、-R6 COOR 7 が好ましく、さらに好ましくは-COOR7 であ り、特に好ましくはメトキシカルボニル基、t-ブトキ シカルボニル基、テトラヒドロピラニルオキシカルボニ ル基等である。

【0063】さらに、ノルボルネン系単量体由来の繰り返し単位の脂環式骨格の置換基のハロゲン原子としては、例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等を挙げることができ、また炭素数1~10の1価の炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基、n-ヘキシル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基基等の(シクロ)アルキル基;フェニル基、4-t-ブチルフェニル基、1-ナフチル基等のアリール基;ベンジル基、4-t-ブチルベンジル基等のアラルキル基等を挙げることができ、また炭素数1~10の1価のハロゲン

化炭化水素基としては、例えば、前記炭素数1~10の 1価の炭化水素基のハロゲン化誘導体を挙げることがで きる。

【0064】酸解離性基含有樹脂(ii)は、例えば、下記(二)~(チ)の方法により製造することができる。

(二):酸解離性基(ii)含有ノルボルネン誘導体 (以下、「ノルボルネン誘導体(α)」と記す。)を、 場合により、開環共重合可能な他の不飽和脂環式化合物 とともに、開環(共)重合する方法、

 $(\pi): J$ ルボルネン誘導体 (α) と、エチレン、無水マレイン酸等の共重合可能な単量体とを付加共重合する方法、

(へ):前記(二)または(ホ)の方法により得られた 樹脂を、常法により部分的に加水分解および/または加 溶媒分解する方法、

(ト);前記(へ)の方法により得られた樹脂中の酸性 官能基の少なくとも一部に、常法により酸解離性基(i i)を導入する方法、

(チ):酸解離性基(ii)含有ノルボルネン誘導体中の該酸解離性基(ii)が解離した酸性官能基を含有するノルボルネン誘導体(以下、「ノルボルネン誘導体(β)」と記す。)を、開環(共)重合あるいは付加共

(β)」と記す。)を、開環(共)重合あるいは付加共 重合して得られた(共)重合体中の該酸性官能基の少な くとも一部に、常法により酸解離性基(ii)を導入す る方法、などが挙げられる。

【0065】本発明に用いる光酸発生剤は、光に感応してブレンステッド酸又はルイス酸を生成する物質である。光の照射によって生成したブレンステッド酸又はルイス酸は、溶解制御剤の酸解離性基を酸性官能基に変える。溶解制御剤は、酸性官能基を持つことにより、それまで親油性ゆえに寄せ付けなかったアルカリ水性液を呼び込む作用を顕わすようになる。光酸発生剤としては、例えば、オニウム塩、ハロゲン化有機化合物、α,αービス(スルホニル)ジアゾメタン化合物、αーカルボニルーαースルホニルージアゾメタン化合物、スルホン化合物、有機酸エステル化合物、有機酸アミド化合物、有機酸イミド化合物などの中から選ばれる。

【0066】オニウム塩の具体例としては、スルホニウム塩、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ヨードニウム塩、ホスホニウム塩、アルソニウム塩、オキソニウム塩等でアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、芳香族基、ヘテロ環状基を有するものが挙げられ、特にスルホニウム塩が好ましい。これらオニウム塩の対アニオンは、特に限定されず、例えば、アンチモン酸、硼素酸、砒素酸、燐酸、スルホン酸、カルボン酸、あるいはこれらのハロゲン化物が挙げられ、特にアンチモン酸が好ましい。具体例としては、トリアリールスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート等が挙げられる。

【0067】ハロゲン化有機化合物の具体例としては、

ハロゲン含有オキサジアゾール化合物、ハロゲン含有ト リアジン化合物、ハロゲン含有アセトフェノン化合物、 ハロゲン含有ベンゾフェノン化合物、ハロゲン含有スル ホキサイド化合物、ハロゲン含有スルホン化合物、ハロ ゲン含有チアゾール化合物、ハロゲン含有オキサゾール 化合物、ハロゲン含有トリアゾール化合物、ハロゲン含 有2-ピロン化合物、ハロゲン含有脂肪族炭化水素化合 物、ハロゲン含有芳香族炭化水素化合物、ハロゲン含有 ヘテロ環状化合物、スルフェニルハライド化合物などを 挙げることができる。さらに、ハロゲン化有機化合物と しては、トリス(2,3-ジブロモプロピル)ホスフェ ート、トリス(2,3ージブロモー3ークロロプロピ ル) ホスフェート、クロロテトラブロモエタン、ヘキサ クロロベンゼン、ヘキサブロモベンゼン、ヘキサブロモ シクロドデカン、ヘキサブロモビフェニル、トリブロモ フェニルアリルエーテル、テトラクロロビスフェノール A、テトラブロモビスフェノールA、ビス(ブロモエチ ルエーテル)テトラブロモビスフェノールA、ビス(ク ロロエチルエーテル)テトラクロロビスフェノールAな どが挙げられる。これらの光酸発生剤は、単独で、また は2種以上を組み合わせて使用することができる。 光酸 発生剤の量は、環状オレフィン系重合体100重量部に 対して、通常、0.5~20重量部であり、好ましくは 1~15重量部、特に好ましくは1~10重量部であ る。光酸発生剤が少なすぎると環状オレフィン系重合体 がアルカリ水性液に対して分散性又は溶解性を発現しな いおそれがあり、逆に、光酸発生剤が多すぎると、パタ ーン形成が少なくなる可能性がある。

【0068】本第一発明組成物に必須成分として用いら れる架橋剤としては、重合性不飽和基含有架橋剤、及 び、酸性基、酸誘導体型残基、水酸基などへの反応性を 有する官能基反応性架橋剤が挙げられる。尚、これらの 架橋剤は、第二発明組成物においても添加することがで きる。重合性不飽和基含有架橋剤の例としては、エチレ ングリコールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグ リコールジ (メタ) アクリレート、1,6ーヘキサンジ オールジ (メタ) アクリレート、1,9-ノナンジオー ルジ(メタ)アクリレート、ジメチロールトリシクロデ カンジ (メタ) アクリレート、1,4-ブタンジオール ジ (メタ) アクリレート、プロピレングリコールジ (メ タ)アクリレート、トリメチロールプロパンアクリル酸 安息香酸エステル、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチル グリコールジ(メタ)アクリレート、ポリテトラメチレ ングリコールジ(メタ)アクリレート、トリメチロール プロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリト ールトリ(メタ)アクリレート、エポキシアクリレート 樹脂類(EH-1001、ES-4004、EX-C1 06\EX-C300\EX-C501\EX-020 2、EX-5000など、共栄化学社製)、ジアリルフ タレート、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシ

アヌレート、ジビニルベンゼンなどが挙げられる。これらのうち、カルボキシル基や水酸基などのアルカリ可溶性官能基を有する架橋剤は、感光性樹脂組成物のアルカリ現像性を高めることができ好ましい。また、脂環式構造を有するものも好ましい。本第一発明組成物における重合性不飽和基含有架橋剤の配合量は、環状オレフィン系重合体100重量部に対して、通常、1~100重量部、好ましくは5~50重量部、さらに好ましくは10~30重量部である。この範囲で重合性不飽和基含有架橋剤を使用することによって、解像度を向上させることができる。

【0069】官能基反応性架橋剤の具体例として、住友 バイエルンウレタン社製のスミジュールN-75、スミ ジュールN3200、スミジュールHT、スミジュール N3500、デスモジュールN3400、デスモジュー ルBL3175、デスモジュールE3265などのヘキ **サメチレンジイソシアネート系ポリイソシアネート:デ** スモジュールBL4165、デスモジュールZ437 O、デスモジュールE41、デスモジュールTPLS2 135、デスモジュールTPLS2078、クラレンU I、クラレンTPLS2147などのイソホロンジイソ シアネート系ポリイソシアネート;スミジュールし、ス ミジュールし1375、スミジュールし1365、デス モジュールIL、SBUイソシアネート0817、スミ ジュールFL-2、スミジュールFL-3、スミジュー ルFL-4、デスモジュールHL、デスモジュールAP ステーブル、デスモジュールCTステーブル、デスモジ ュールBL1100、デスモジュールBL1190、デ スモジュールBL1265、デスモジュールE116 0、デスモジュールE1240、デスモジュールE14 などのトリレンジイソシアネート系ポリイソシアネー ト;スミジュールE21-1、スミジュールE21-2、デスモジュールE22、デスモジュールE23、デ スモジュールE25、デスモジュールE2680、デス モサーム2170、デスモサーム2265などのジフェ ニルメタンジイソシアネート系ポリイソシアネート;デ スモジュールE27:デスモジュールTPLS211 7、クラレンTPLS2007、クラレンTPLS21 22などの水添ジフェニルメタンジイソシアネート系ポ リイソシアネート;

【0070】エポキシ化合物、エポキシ樹脂、好ましくは脂環式構造含有のエポキシ化合物又は樹脂;1,4-ジー(ヒドロキシメチル)シクロヘキサン、1,4-ジー(ヒドロキシメチル)ノルボルナン;1,3,4-トリヒドロキシシクロヘキサン;ヘキサメチレンジアミンなどが挙げられる。これらの中でも、スミジュールBL3175、デスモジュールTPLS2759、デスモジュールTPLS2062、バイヒドロール116などのヘキサメチレンジイソシアネート系ポリイソシアネート、デスモジュールA

Pステーブル、デスモジュールCTステーブル、デスモ ジュールBL1100、デスモジュールBL1265な どのトリレンジイソシアネート系ポリイソシアネート、 デスモサーム2170、デスモサーム2265などのジ フェニルメタンジイソシアネート系ポリイソシアネー ト、デスモジュールTPLS2117、クラレンTPL S2007、クラレンTPLS2122などの水添ジフ ェニルメタンジイソシアネート系ポリイソシアネート、 デスモジュールTPLS2135、デスモジュールTP LS2078、クラレンUI、クラレンTPLS214 7などのイソホロンジイソシアネート系ポリイソシアネ ート;などのブロック型イソシアネートが好ましい官能 基反応性架橋剤の量は、環状オレフィン系重合体100 重量部に対して、通常、1~100重量部、好ましくは 5~50重量部、さらに好ましくは10~30重量部で ある。官能基反応性架橋剤をこの範囲の量で使用するこ とによって、感光した後に行う後硬化処理(ポストベー ク処理)において、環状オレフィン系重合体中の酸性基 又は酸誘導体型残基と反応して、感光性樹脂組成物の硬 化物の耐熱性、低誘電性、低吸水性などを向上させるこ とができる。

【0071】さらに本発明の感光性樹脂組成物には、ス トリエーション(塗布すじあと)の防止、現像性の向上 等の目的で、界面活性剤を含有させることができる。界 面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンラウリル エーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテルル等 のポリオキシエチレンアルキルエーテル類:ポリオキシ エチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレ ンノニルフェニルエーテル等のポリオキシエチレンアリ ールエーテル類:ポリオキシエチレンジラウレート、ポ リオキシエチレンジステアレート等のポリオキシエチレ ンジアルキルエステル類等のノニオン系界面活性剤:エ フトップEF301、同303、同352(新秋田化成 (株)製)、メガファックF171、同F172、同F 173(大日本インキ化学工業(株)製)、フロラード FC-430、同FC-431(住友スリーエム(株) 製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-38 2、同SC-101、同SC-102、同SC-10 3、同SC-104、同SC-105、同SC-106 〔旭硝子(株)製〕等のフッ素系界面活性剤;オルガノ シロキサンポリマーKP341〔信越化学工業(株) 製〕、ポリフローNo.57、同95〔共栄社油脂化学 工業(株)製〕等の(メタ)アクリル酸共重合体系界面 活性剤が挙げられる。上記界面活性剤は、感光性樹脂組 成物の固形分100重量部に対して、通常、2重量部以 下、好ましくは1重量部以下の量で必要に応じて用いら れる。

【0072】本発明の感光性樹脂組成物には、耐熱性、耐薬品性を向上する目的で熱酸発生剤を配合することもできる。本発明で用いられる熱酸発生剤は、加熱により

酸を発生する物質である。例えば、スルホニウム塩、ベ ンゾチアゾリウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩 のごときオニウム塩が挙げられる。これらの中でも、ス ルホニウム塩およびベンゾチアゾリウム塩が好ましい。 スルホニウム塩の具体例としては、4-アセトフェニル ジメチルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、 **4-アセトフェニルジメチルスルホニウムヘキサフルオ** ロアルセネート、ジメチルー4ー(ベンジルオキシカル ボニルオキシ) フェニルスルホニウムヘキサフルオロア ンチモネート、ジメチルー4ー(ベンゾイルオキシ)フ ェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジ メチルー4-(ベンゾイルオキシ)フェニルスルホニウ ムヘキサフルオロアルセネート等のアルキルスルホニウ ム塩:ベンジルー4-ヒドロキシフェニルメチルスルホ ニウムヘキサフルオロアンチモネート、4-アセトキシ フェニルベンジルメチルスルホニウムヘキサフルオロア ンチモネート、ベンジルー4ーメトキシフェニルメチル スルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、ベンジル -3-クロロ-4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニ ウムヘキサフルオロアルセネート、4-メトキシベンジ ルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウムヘキサ フルオロホスフェート等のベンジルスルホニウム塩; 【0073】ジベンジルー4-ヒドロキシフェニルスル ホニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジベンジルー 4-ヒドロキシフェニルスルホニウムヘキサフルオロホ スフェー、ジベンジルー4-メトキシフェニルスルホニ ウムヘキサフルオロアンチモネート、ベンジルー4-メ トキシベンジルー4-ヒドロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート等のジベンジルスルホニウ ム塩:p-クロロベンジル-4-ヒドロキシフェニルメ チルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、p-ニトロベンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホ ニウムヘキサフルオロアンチモネート、3,5ージクロ ロベンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウ ムヘキサフルオロアンチモネート、ロークロロベンジル -3-クロロ-4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニ ウムヘキサフルオロアンチモネート等の置換ベンジルス

【0074】ベンゾチアゾニウム塩の具体例としては、3-ベンジルベンゾチアゾリウムへキサフルオロアンチモネート、3-ベンジルベンゾチアゾリウム ヘキサフルオロホスフェート、3-ベンジルベンゾチアゾリウムテトラフルオロボレート、3-(p-メトキシベンジル)ベンゾチアゾリウムへキサフルオロアンチモネート、3-ベンジルー2-メチルチオベンゾチアゾリウムへキサフルオロアンチモネート等のベンジルベンゾチアゾリウム塩が挙げられる。これらの熱酸発生剤うち、4-アセトキシフェニルジメチルスルホニウムへキサフルオロアルセネート、ベンジ

ルホニウム塩などが挙げられる。

ルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート、4ーアセトキシフェニルベンジルメチルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート、ジベンジルー4ーヒドロキシフェニルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート、3ーベンジルベンゾチアゾリウムへキサフルオロアンチモネート等が好ましく用いられる。これらの熱酸発生剤は、単独であるいは2種以上組み合わせて用いることができる。

【0075】本発明の感光性樹脂組成物には、基板との密着性を向上させる目的で、密着助剤を含んでいてもよい。このような密着助剤としては、官能性シランカップリング剤の具体例としては、トリメトキシシリル安息香酸、アーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、βー(3,4ーエボキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン等が挙げられる。該密着助剤の量は、環状オレフィン系重合体100重量部に対して、通常、20重量部以下、好ましくは0.05~10重量部、特に好ましくは1~10重量部である。

【0076】さらに本発明の感光性樹脂組成物には、必 要に応じて増感剤、帯電防止剤、保存安定剤、消泡剤、 顔料、染料等を含んでいてもよい。増感剤としては、ベ ンゾフェノン、アントラキノン、1,2-ナフトキノ ン、1, 4 -ナフトキノン、ベンズアントロン、p, p'ーテトラメチルジアミノベンゾフェノン、クロラニ ル、アデカオプトマーSP100のごときカルボニル化 合物; ニトロベンゼン、p - ジニトロベンゼン、2 - ニ トロフルオレン、ニトロピレンのごときニトロ化合物; アントラセン、クリセンのごとき芳香族炭化水素;ジフ ェニルジスルフィドのごときイオウ化合物;ニトロアニ リン、2-クロロー4-ニトロアニリン、5-ニトロー 2-アミノトルエン、テトラシアノエチレンのごとき窒 素化合物が挙げられる。保存安定剤としては、ヒドロキ ノン、メトキシフェノール、p‐t‐ブチルカテコー ル、2,6-ジーセーブチルーpークレゾールのごとき ヒドロキシ芳香族化合物;ベンゾキノン、p-トルキノ ンのごときキノン化合物;フェニルーα-ナフチルアミ ンのごときアミン化合物; 4, 4'ーチオビス(6-t ーブチルー3ーメチルフェノール)、2,2'ーチオビ ス(4-メチル-6-t-ブチルフェノール)のごとき 硫黄化合物などが挙げられる。

【0077】本発明の感光性樹脂組成物は、第一発明組成物においては環状オレフィン系重合体、溶解制御剤、光酸発生剤及び架橋剤を必須成分とし、第二発明組成物においては重合性不飽和基を含有する環状オレフィン系重合体、溶解制御剤及び光酸発生剤の他に必要に応じて架橋剤を配合成分とする。さらに第一、第二発明組成物

とも状況により上記の任意成分を加え、均一に混合する ことによって容易に調製することができる。第一、第二 発明組成物とも、通常、適当な溶媒に溶解されて溶液状態で用いられる。

【0078】該溶媒としては、例えば、メタノール、エ タノール、プロパノール、ブタノール等のアルコール 類;テトラヒドロフラン、ジオキサン等の環状エーテル 類;メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブア セテート等のセロソルブエステル類; エチレングリコー ルモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチル エーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、 ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレン グリコールジメチルエーテル、プロピレングリコールモ ノメチルエーテル等のグリコールエーテル類;プロピレ ングリコールメチルエーテルアセテート、プロピレング リコールプロピルエーテルアセテート等のプロピレング リコールアルキルエーテルアセテート類:ベンゼン、ト ルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類;メチルエチル ケトン、シクロヘキサノン、2-ヘプタノン、4-ヒド ロキシー4ーメチルー2ーペンタノン等のケトン類;2 ーヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシー2 ーメチルプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシー2-メ チルプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロ キシ酢酸エチル、2-ヒドロキシ-3-メ*チ*ルブタン酸 メチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキ シプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸エチ ル、3-エトキシプロピオン酸メチル、酢酸エチル、酢 酸ブチル、乳酸エチル等のエステル類;

【0079】ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドン等の非プロトン性極性溶媒が挙げられる。N ーメチルホルムアミド、N,Nージメチルホルムアミ ド、N-メチルホルムアニリド、N-メチルアセトアミ ド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルピロリ ドン、ジメチルスルホキシド、ベンジルエチルエーテ ル、ジヘキシルエーテル、アセトニルアセトン、イソホ ロン、カプロン酸、カプリル酸、1-オクタノール、1 -ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安 息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチ ル、アーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレ ン、フェニルセロソルブアセテート等の溶媒を用いるこ ともできる。これらの溶媒のうち、溶解性および塗膜の 形成のしやすさから、ケトン類、グリコールエーテル類 又はアミド類が好ましく用いられる。本発明の感光性樹 脂組成物の固形分濃度は、特に限定されないが、通常与 ~40重量%である。また、上記のようにして調製され た感光性樹脂組成物溶液は、O.2~1μm程度のフィ ルタ等を用いて異物などを除去した後、使用に供するこ とが好ましい。

【0080】本発明の感光性樹脂組成物は、液晶表示素子、集積回路素子、固体撮像素子等の電子素子や、液晶

ディスプレー用カラーフィルターなどの劣化や損傷を防 止するための保護膜、素子表面や配線を平坦化するため の平坦化膜、電気絶縁性を保つための絶縁膜、特に、薄 膜トランジスタ型液晶表示素子や集積回路素子の層間絶 縁膜等の各種電子部品用硬化膜の材料として好適であ る。上記各種の硬化膜を形成するには、本発明の感光性 樹脂組成物の溶液を上記各種素子の基板表面等に塗布 し、加熱し、溶媒を除去して製膜することができる。基 板表面への感光性樹脂組成物溶液の塗布方法としては、 例えばスプレー法、ロールコート法、回転塗布法等の各 種の方法を採用することができる。次いでこの塗膜は、 加熱 (プリベーク: Pre-Bake) される。加熱す ることによって、溶媒が揮発し、流動性のない塗膜が得 られる。加熱条件は、各成分の種類、配合割合等によっ ても異なるが、通常60~120℃で10~600秒間 程度である。

【0081】次に加熱された塗膜に所定パターンのマス クを介して光を照射する。光照射を受けた光酸発生剤は 酸を生成する。生成した酸が、それまで環状オレフィン 系重合体と混ざり合ってアルカリ水性液を寄せつけにく くしていた溶解制御剤の酸解離性基を酸性官能基に変化 せしめるため、アルカリ水性液が容易に環状オレフィン 系重合体に接触してこれをアルカリ水性液に分散もしく は溶解せしめることが可能となる。光照射後、必要に応 じて加熱 (PEB処理: Post Exposure Bake)した後、光照射によりアルカリ水性液に分散 性もしくは溶解性となった不要な部分をアルカリ性の現 像液で洗浄、除去することにより現像する。なお、Po st Exposure Bakeを行うことにより、 パターンの現像(不要部分の抜け)性が良好になること がある。環状オレフィン系重合体がアルカリ溶解性極性 基を有していると、現像液による流出がより容易になる ので好ましい。

【0082】パターンを現像するためのアルカリ水性液 としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、 炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリ ウム、アンモニア水等の無機アルカリ類;エチルアミ ン、nープロピルアミン等の第一級アミン類;ジエチル アミン、ジーnープロピルアミン等の第二級アミン類; トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、N-メチル ピロリドン等の第三級アミン類;ジメチルエタノールア ミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類; テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチル アンモニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウム ヒドロキシド、コリン等の第四級アンモニウム塩;ピロ ール、ピペリジン、1,8-ジアザビシクロ[5.4. 0] - 7 - ウンデセン、1,5 - ジアザビシクロ[4. 3.0]-5-ノナン等の環状アミン類などのアルカリ 類の水溶液を用いることができる。また上記アルカリ水 溶液に、メタノール、エタノール等の水溶性有機溶媒、

界面活性剤等を適当量添加した液を現像液として使用することもできる。

【0083】現像時間は、通常30~180秒間であ る。また現像方法はパドル法、液盛り法、ディッピング 法等のいずれでもよい。現像後、流水洗浄を行い、圧縮 空気や圧縮窒素で乾燥させることによって、基板上の水 分を除去し、パターン状被膜が形成される。その後この パターン状被膜に、必要に応じて高圧水銀灯等による光 線を全面照射する。続いて、ホットプレート、オーブン 等の加熱装置により、所定温度、例えば150~250 ℃で、所定時間、例えばホットプレート上なら5~30 分間、オーブン中では30~90分間加熱処理(ポスト ベーク:PostBake)をする。ポストベークによ り、本第一発明組成物を用いたときは環状オレフィン系 重合体と架橋剤とが反応し、本第二発明組成物を用いた ときは環状オレフィン系重合体自らが持つ重合性不飽和 基により架橋し、さらに架橋剤を添加した場合は第一発 明組成物における上記効果も加わって、パターン状架橋 被膜を得ることができる。加熱処理は、低酸素雰囲気 中、具体的には酸素濃度10ppm以下の雰囲気中で行 うことが好ましい。

[0084]

【実施例】以下に、実施例及び比較例を挙げて本発明を 具体的に説明する。なお、実施例中、「部」は、特に断 りのない限り「重量部」のことである。

<試験及び評価方法>

(1)変性率

環状オレフィン系重合体主鎖の水素添加率及び環状オレフィン系重合体のグラフト変性率は、 ¹ H-NMRにより測定した。

(2)加水分解率

加水分解後の環状オレフィン系重合体の変性物の加水分解率は、FT-IR、第一級アミンによる修飾後の環状オレフィン系重合体グラフ変性物の修飾率は1H-NMRにより測定した。

(3)分子量

数平均分子量(Mn)及び重量平均分子量(Mw)は、 ジメチルアセトアミドを溶媒とするゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー(GPC)によるポリスチレン換算値として測定した。

(4)誘電率

JIS C6481に準じて、1MHz (室温)での誘電率 (ε)を測定した。

【0085】(5)耐熱寸法安定性

パターン状薄膜を形成したシリコン基板を220℃のオーブンを用いて60分間加熱し、加熱前の膜厚に対する加熱後の膜厚の割合が、95%超の場合を○、90~95%の場合を△、90%未満の場合を×とした。

(6)平坦性

塗膜つきの、1μmの段差を有するシリコン酸化膜基板

の最大段差(d)を、接触式の膜厚測定器を用いて測定し、dが5%未満の場合を○、dが5%以上の場合を×として評価した。

(7)透明性

塗膜つきのガラス基板(コーニング7059、コーニング社製)の透過率を、日本分光社製紫外可視近赤外分光光度計(V-570)を用いて400~800nmの波長での最低光線透過率(t)を測定し、tが95%以上の場合を○、tが93%未満の場合を×として評価した。

(8)耐熱変色性

上記の塗膜付きガラス基板を220℃のオーブンで60分間加熱した後、このガラス基板の透過率を上記(7)と同様に測定し、加熱前後の変化率(T)を算出し、Tが1%未満の場合を○、Tが2%以上で3%の場合を△、Tが3%以上の場合を×として評価した。

【0086】(9)耐溶剤性

パターン状薄膜を形成したガラス基板 (パターン状塗膜を形成したシリコン基板と方法で作製)を70℃のジメチルスルフォキシド中に15分間浸漬して、浸漬後の膜厚と浸漬前の膜厚との差の浸漬前膜厚に対する百分率〔膜厚変化率(S)〕を求める。Sが10%未満の場合を○、Sが10%超の場合を△、膨潤が激しく膜が基板から剥がれた場合を×として評価した。

(10)脱ガス性

フィン系重合体の製造

塗膜つきの、1μmの段差を有するシリコン酸化膜基板を、樹脂量が一定になる様に1cm角に切り取り、これを230℃×10分の条件で加熱し、発生したガスを冷却したガラストラップ内で捕集した後、ガスクロマトグラフィー/マススペクトロメトリーによって発生ガス成分の総量(G)を測定し、Gが3ppm未満の場合を○、Gが3ppm以上で5ppm未満の場合を△、Gが5ppm以上の場合を×とする基準にて評価した。【0087】[合成例1]重合性不飽和基含有環状オレ

六塩化タングステン、トリイソブチルアルミニウム及びイソブチルアルコールからなる重合触媒と分子量調整剤として1-ヘキセンを用い、8-エチルテトラシクロ[4.4.0.1²・5 .17・10]-3-ドデセン(以下、ETDと略す。)を開環重合した。得られた開環重合体を、各々ニッケルアセチルアセトナートとトリイソブチルアルミニウムの水素添加触媒を用いて水素化し、水素化率が99%以上の開環重合体水素添加物を得た。次いで、オートクレーブ中で開環重合体水素添加物100部、無水マレイン酸150部、及びセーブチルベンゼン400部とアニソール500部を混合し、135℃に昇温した。この反応容器に、ジクミルペルオキシド15部を10分割し12分間隔で逐次添加した後、3時間反応させた。次いで反応液を大量のイソプロパノール中に滴下し、凝固、乾燥し、無水マレイン酸変性ポリ

マーを得た。Mnは8900、無水マレイン酸変性率は65モル%であった。無水マレイン酸変性ポリマー100部を乾燥したジメチルアセトアミドで溶解させた後、アリルアミン20部を添加して常温にて1時間反応させた。この反応溶液を上記と同様に大量のノルマルヘキサンで凝固、乾燥してアリル変性ポリマー(ポリマーA)を得た。このポリマーAは、FT-IRによる分光分析からアミド基を豊富に含むもので、アリル基含有率が63モル%であった。

【0088】[合成例2]環状オレフィン系重合体の製造

8-メチル-8-メトキシカルボニルテトラシクロ [4.4.0.12.5.17.10] -3ードデセン 250部を窒素置換した反応容器に仕込み、60℃に加 熱した。これにトリエチルアルミニウム(1.5モル/ 1)のトルエン溶液0.62部、tert-C₄ H 5 OH/CH₃ OHで変性(tert-C₄ H $_{5}$ OH/CH₃ OH/W=0.35/0.3/1: モル比)したWC16 溶液(濃度0.05モル/1) 3. 7部を加え、80℃で3時間攪拌、加熱して開環重 合体溶液を得た。重合転化率は90%、Mwは17,0 00であった。得られた重合体溶液4,000部をオー トクレーブに入れ、これにRuHCl(CO)(P(C 6 H₅)₃ 〕30.4部を加え、水素ガス圧を1 00kg/cm² 、反応温度165℃の条件で3時間 攪拌、加熱した。得られた反応溶液を冷却した後、水素 ガスを除き、水素添加重合体溶液を得た。得られた水素 添加重合体溶液を大量のメタノールに注いで重合体を凝 固させた。水素添加率は実質100%であった。乾燥し た水素添加重合体100部、N-メチルピロリドン10 〇部、プロピレングリコール500部、水酸化カリウム (8.5%)84.5部を反応器に仕込み、温度190 ℃で4.5時間撹拌、加熱した。得られた反応溶液を大 量の水、テトラヒドロフラン及び塩酸の混合溶液に注い で加水分解物を凝固させた。凝固ポリマーを水洗、乾燥 して加水分解ポリマー(ポリマーB)を得た。加水分解 率は96%であった。

【0089】[合成例3]溶解制御剤Aの合成メタクリル酸セーブチル60部、メタクリル酸20部、イソボニルメタクリレート20部、アゾビスイソブチロニトリル2部、セードデシルメルカプタン1.5部およびエチレングリコールジメチルエーテル250部を仕込み、70℃にて6時間重合した。これをノルマルヘキサン中で凝固した後、樹脂分をろ過・真空乾燥してMnが7,300であるメタクリル酸セーブチルーメタクリル酸メチルランダム共重合体(溶解制御剤A)を得た。

【0090】 [実施例1] 合成例1で得たポリマーA100部に対して、合成例3で得られた溶解制御剤A25部、光酸発生剤としてトリアリールスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート [SP-172 旭電化工業

(株)製)5部、増感剤としてSP-100〔旭電化工 ピルトリメトキシシラン1部および界面活性剤 [メガフ ァックF172 大日本インキ化学工業(株)製〕O. 05部を、固形分濃度が25重量%となるようにジメチ ルアセトアミドに溶解した。調製した溶液を0.45μ mのミリポアフィルターにてろ過し、シリコン基板上、 ガラス基板上、および1μmの段差を有するシリコン酸 化膜基板上にそれぞれスピンコートした後、90℃にて 2分間ホットプレート上でプリベークして、膜厚3.0 μmの塗膜を形成した。得られた塗膜付きのシリコン基 板上に所定のパターンを有するマスクを置き、波長36 5 n m、光強度 5 m W / c m 2 の紫外線を空気中で 5 OmJ/cm² のエネルギー量となるように照射し た。照射後に110℃のホットプレート上でPEB処理 を2分間行った。次いで0.3wt%のテトラメチルア ンモニウム水溶液を用いて、25℃×60秒間の現像処 理を行った。その後、超純水でリンス処理を1分間行っ た。こうしてポジ型のパターンを有する薄膜を形成し た。このパターンが形成されたシリコン基板と露光・現 像処理をしていない塗膜付きのガラス基板および塗膜付 きの1 µmの段差を有するシリコン酸化膜をホットプレ ート上で200℃で30分間加熱する事により、パター ンおよび塗膜のポストベークを行い、パターン状薄膜を 形成したシリコン基板、塗膜付きガラス基板及び塗膜付 きのシリコン酸化膜の1μmの段差を有する基板を得 た。得られた各種の基板を用いて、誘電率、透明性、耐 熱変色性、平坦性、耐熱寸法安定性、耐溶剤性、脱ガス 性を評価した。結果を表1に示す。

【0091】[実施例2]合成例3で得られた溶解制御 剤A25部を、溶解制御剤B[Di-BOC BisphenolA、ミドリ化学(株)製、2,2-ビス(4-ブトキシカルボキシフェニル)プロパン]20部に代えた他は実施例1と同様にして、パターン状薄膜を形成したシリコン基板、塗膜付きガラス基板及び塗膜付きの1μmの段差を有するシリコン酸化膜基板を得た。得られた各種の基板をおよび用いて、誘電率、透明性、耐熱変色性、平坦性、耐熱寸法安定性、耐溶剤性、脱ガス性を評価した。結果を表1に示す。

[実施例3]ポリマーA100部をポリマーB100部に代え、溶解抑止剤A25部を20部に減じ、トリアリルイソシアネート20部を加える他は実施例1と同様にして、パターン状薄膜を形成したシリコン基板、塗膜付きガラス基板及び塗膜付きの1μmの段差を有するシリコン酸化膜基板を得た。得られた各種の基板をおよび用いて、誘電率、透明性、耐熱変色性、平坦性、耐熱寸法安定性、耐溶剤性、脱ガス性を評価した。結果を表1に示す。

[実施例4]トリアリルイソシアネート20部をジペン タエリスリトールヘキサアクリレート [DPHA、日本 化薬(株)製)20部に代える他は実施例3と同様にして、パターン状薄膜を形成したシリコン基板、塗膜付きガラス基板及び塗膜付きの1μmの段差を有するシリコン酸化膜基板を得た。得られた各種の基板をおよび用いて、誘電率、透明性、耐熱変色性、平坦性、耐熱寸法安定性、耐溶剤性、脱ガス性を評価した。結果を表1に示す。

【0092】[比較例1]合成例1で得たポリマーA100部、光酸発生剤として1,1,3ートリス(2,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニルー3ーフェニル)プロパン(1モル)と1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸クロリド(1.9モル)との縮合物20重量部、架橋剤としてアルコキシルメチル化メラミン〔CYMEL300、三井サイテック(株)製〕25部、接着助剤としてグリシドキシプロピルトリメトキシシラン5部、界面活性剤〔メガファックF-172、大日本インキ化学工業(株)製〕0.05部をシクロへキ

サノン550部に混合、溶解後、0.45μmのミリポアフィルターにてろ過した。この組成物を用いた他は実施例1と度王朝にしてパターン状薄膜を形成したシリコン基板、塗膜付きガラス基板及び塗膜付きの1μmの段差を有するシリコン酸化膜基板を得た。得られた各種の基板をおよび用いて、誘電率、透明性、耐熱変色性、平坦性、耐熱寸法安定性、耐溶剤性、脱ガス性を評価した。結果を表1に示す。

[比較例2]比較例1において、ポリマーAに代えてポリマーBを用いた他は比較例1と同様にして、パターン 状薄膜を形成したシリコン基板、塗膜付きガラス基板及 び塗膜付きの1μmの段差を有するシリコン酸化膜基板 を得た。得られた各種の基板をおよび用いて、誘電率、 透明性、耐熱変色性、平坦性、耐熱寸法安定性、耐溶剤 性、脱ガス性を評価した。結果を表1に示す。

[0093]

【表1】

表 1

	ポリマ -		治保制對於		光膜発生剂		奈衡剂		平坦性	耐色小法	對熱資色	运动性	耐溶剂注	影ガス性	譜寫率
	種類	部族	機類	多數	祖卿 +1	部数	起棄 +2	印数		安定注	性				
突施例1	A	100	A	25	TASHE	5	_	ı	0	0	0	0	0	0	2.48
突旋例2	A	100	В	25	TASHF	3	-	_	0	0	0	0	0	0	2.55
實施制3	В	100	A	20	FASHF	5	TAIC	20	0	0	0	0	0	0	2.68
突旋例4	8	100	A	70	FASHF	5	DHEA	20	0	0	0	0	٥	0	2.74
比較到1	A	100	-	_	NQD	20	CML	25	٥	0	×	×	0	×	2.70
比較例2	8	100		_	NQD	20	CMIL	25	0	0	ж	×	0	×	2.73

+1 光陰発生剂

TASHF: トリアリールスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート

NQD :1,1,3-トリス(2,5-ジッチルー4-ヒトロキシフェニル-3-フェニル)フ・ロハンメ(モル)とし、ナーナフトキノンジ・アジト・-5-スルキン酸クロリト(1,9モル)との総合物

+2 架档剂

で 米され。 TAIC :トリアリルイソシアネート

DPHA :ジベンタエリ人リトールヘキサアクリレート

:CYMEL300、三井サイテック制製、アルコキシルメチル化メラミン

【0094】表1が示すように、本発明例(実施例1~4)は、低誘電特性、耐熱寸法安定性、平坦性、耐熱変色性、透明性、耐溶剤性及び脱ガス性のいずれの特性にも優れる。一方、溶解制御剤を用いていないと、低誘電特性、耐熱寸法安定性、平坦性及び耐溶剤性に優れていても、耐熱変色性、透明性及び脱ガス性に劣った(比較例1、2)。

[0095]

【発明の効果】本発明の感光性樹脂組成物は、シリコン 基板上などに塗布乾燥し、パターン露光し、その後現像 することによって、平坦性、耐熱性、透明性、耐薬品性等の諸性能に優れるとともに、脱ガス性が良く、低誘電性に優れ、微細なパターン状薄膜を容易に形成することができる。本発明の感光性樹脂組成物によって得られる硬化膜は、絶縁材料として、例えば、半導体素子、発光ダイオード、各種メモリー類のごとき電子素子;ハイブリッドIC、MCM、プリント配線基板等のオーバーコート材;多層回路基板の層間絶縁膜;液晶ディスプレーの絶縁層など各種の電子部品用硬化膜として好適である。

フロントページの続き

(51) Int. CI.7 GO3F 7/40 501 HO1L 21/027

FI G03F 7/40 501 H01L 21/30 502R

(参考)

Fターム(参考) 2H025 AA00 AA06 AA07 AA08 AA10

AB15 AB16 AB17 AC01 AD03

BC51 BE00 BE10 BG00 CB08

CC20 FA03 FA12 FA17 FA29

2H096 BA11 BA20 EA02 FA01 GA08

HA01

4J002 BC022 BC122 BG012 BG072

BH022 BK001 BK002 CD003

CE001 CK023 EA048 ED056

EE036 EH007 EH078 EH126

EL028 EN137 EP007 EQ017

ER008 EU198 EV066 EV076

EV196 EV216 EV217 EV237

EV297 EW177 FD143 FD148

FD202 FD206 FD207 FD310

GP03 GQ00 GQ01 GQ05